

## 顕微鏡式薄膜測定装置



### 【主な仕様】

- ・分光波長範囲: 400-850nm
- ・分光器の形式: 1024素子CCD付固定型 Czerny-Tuner形分光器
- ・膜厚測定精度:  $\pm 1\text{nm}$ (500nm測定時)
- ・膜厚測定範囲:  $\sim 20\ \mu\text{m}$ ( $\times 5$ )  
 $\sim 15\ \mu\text{m}$ ( $\times 10$ )  
 $\sim 2\ \mu\text{m}$ ( $\times 50$ )

### 【データ出力】

記録メディア **USB** **FD**

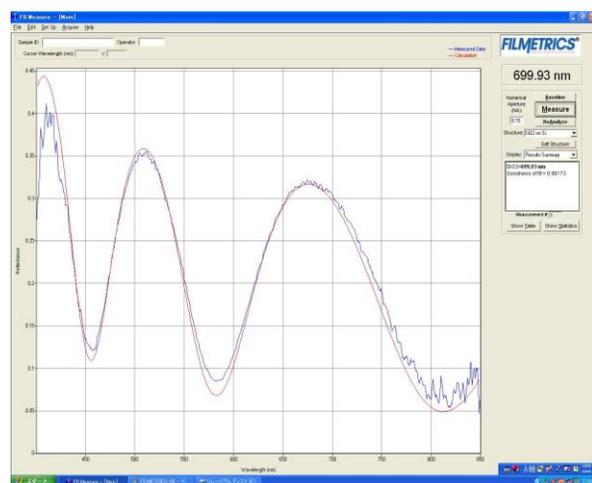
保存形式 **ASCII形式** **専用形式**

### 機種名

**フィルメトリクス F40**  
2006年度購入

### 特徴

- 光学顕微鏡で同定した微小領域の薄膜の厚さが数秒で測定できます。
- 反射率を測定し、シミュレーション結果と比較することで、膜厚を算出します。



Siウエハ上のSiO<sub>2</sub>の膜厚測定結果

### 料金等

施設開放: 600 円 / 時

操作法説明: 3,900 円 (1時間)

※その他、基礎～応用まで別途相談承ります。

研究員による支援

3,900 円 / 時

測定・解析の支援・指導

機器操作など

ご利用申し込みは実施日の前日まで可能です。